POROUS CERAMIC

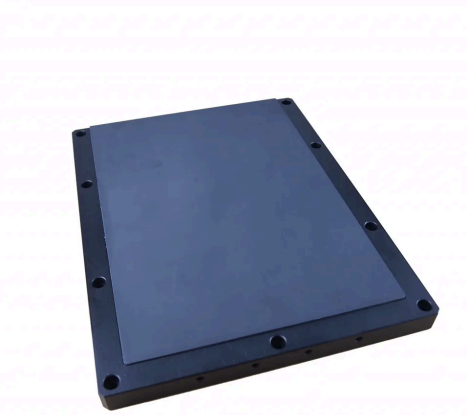
多孔陶瓷真空吸盤

大尺寸真空吸盤．大型陶瓷吸盤

Porous Ceramic Vacuum Chuck

多孔陶瓷真空吸盤用陶瓷內部均勻的微小氣孔吸住整片工件，適合薄型、容易翹曲的晶圓、薄膜與玻璃基板。佐和科技可客製大尺寸陶瓷真空吸盤，取代傳統鋁製吸盤。

可吸附翹曲、鏤空工件、玻璃基板材料類型等作業物。實績尺寸 10×10 mm～1,500×1,850 mm，依設備與製程客製。



FEATURES

產品特點

高精度 Flatness

平面度可達 <10～50 μm（視尺寸而定）。

多尺寸用途

工件覆蓋載台超過 30% 面積即可穩固吸附；可另外設計「隱形」或「展示」分區吸附。

不傷工作物 Pore size 2 μm

孔徑可小到 2 μm，避免吸附時工件凹陷變形，適用高精度要求的矽晶圓、薄膜、玻璃等工件。

防靜電 Static dissipative

表面阻抗 10^6～10^9 Ω，屬靜電消散材質。

耐熱、耐化學、耐磨耗

高溫燒結產物、陶瓷為惰性原料；表面損傷可再研磨去除，延長使用壽命。

輕量、不發塵

內部為均勻氣孔；陶瓷完全燒結，不發塵。

SPECIFICATION

產品規格

應用 Application	客製化設計（主要替換現有使用鋁製吸盤的使用者）
材質 Material	多孔陶瓷
孔徑 Pore size	2～100 μm（客製化）
孔隙率 Porosity	40～60%
平面度 Flatness	<10～50 μm（視尺寸而定）
尺寸 Dimension / Max. size	客製化設計；實績尺寸 10×10 mm～1,500×1,850 mm
表面阻抗 Surface resistance	10^6～10^9 Ω（靜電消散）
顏色 Color	黑 / 土黃 / 灰

分區吸附 Zoned suction	可設計「隱形」或「展示」分區吸附（提升吸附能力、增加可吸附工件尺寸的多樣性）
耐熱溫度 Max. operating temperature	≤ 90 °C
厚度 Thickness	依需求客製化

孔徑、孔隙率依用途搭配，實際規格以報價圖面為準。

APPLICATIONS

應用

AOI 檢測　移載　研磨　切割

客製化設計，主要替換現有使用鋁製吸盤的使用者。

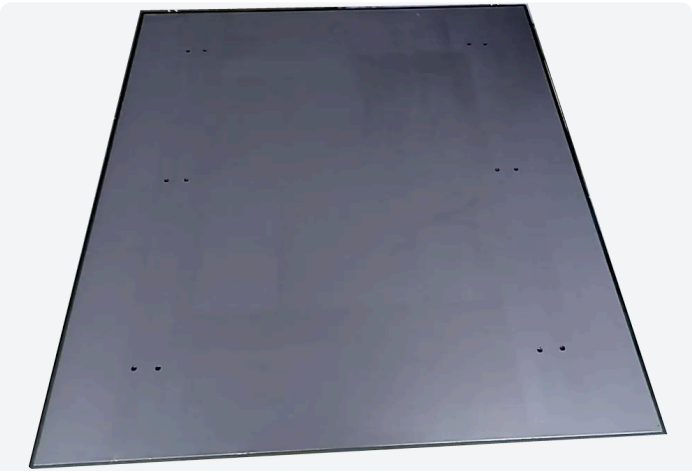
設備商　面板廠　檢測段（OLED）　光學鏡頭

解決破真空問題、降低工作物 particle 與 mura 問題、翹曲吸平、提升機台稼動率及優化自動化製程（針對薄型、柔性之工作物效果更為顯著）。

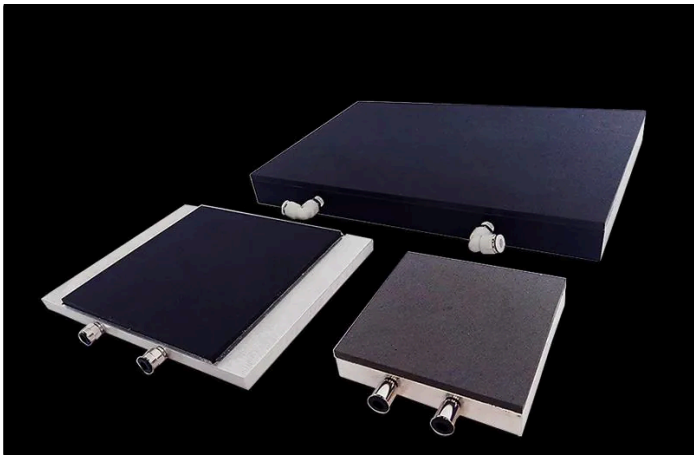
傳統吸盤只能吸附單一規格的工件；陶瓷真空吸盤可區域性吸附，有助於提升產線流暢度，也能避免傳統吸盤容易造成的刮傷與吸痕。

PHOTOS

實品照片



大尺寸吸盤



多種尺寸與形狀